

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 6 部門第 4 区分
【発行日】平成 17 年 6 月 9 日 (2005.6.9)

【公開番号】特開 2004-342210 (P2004-342210A)
【公開日】平成 16 年 12 月 2 日 (2004.12.2)
【年通号数】公開・登録公報 2004-047
【出願番号】特願 2003-136697 (P2003-136697)
【国際特許分類第 7 版】

G 1 1 B 5/31

【F I】

G 1 1 B 5/31 C

【手続補正書】
【提出日】平成 16 年 8 月 20 日 (2004.8.20)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 1 4 1
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0 1 4 1】

また、請求項 15 記載の垂直磁気記録用磁気ヘッドの製造方法では、第 2 層を形成する工程は、第 1 層の上に、第 2 層を形成するための被パターンニング層を形成する工程と、被パターンニング層の上に、被パターンニング層をパターンニングするためのエッチングマスクを形成する工程と、エッチングマスクを用いて、被パターンニング層および第 1 層を選択的にエッチングする工程とを含んでいる。そして、エッチングする工程において、被パターンニング層がパターンニングされることによって第 2 層が形成され、且つ第 1 層がパターンニングされる。本発明によれば、第 1 層と第 2 層との位置合わせを正確に行うことができ、その結果、良好な記録特性を実現することができるという効果を奏する。